



■ 特長

■ 優れた面内温度分布を実現

発熱体(ヒーター)は熱解析により、改良、改善を繰り返し行い高精度化を追求しております。

■ 量産に最適

より高い再現性を追求した結果、発熱体はパターン化を行い個体間の精度のばらつきを最小に抑えました。

■ オープンユニットで製作対応

ウェーハ上、ガラス基板上の温度分布向上の為にオープンユニットで製作対応いたします。

■ Application

半導体、FPD製造装置の各熱処理プロセスの、次のような工程に採用実績があります。

- PEB (化学増幅型レジストバーク)
- レジストバークプレート
- HMDSバークプレート
- 脱水バークプレート
- CVD用プレート
- エッチャー用プレート
- アッシング用プレート
- スパッタ用プレート
- ハンドラ用プレート

